

半自動平行曝光機

c sun

SEMI-AUTO COLLIMATED UV EXPOSURE SYSTEM

UVE-M565 F/L



UVE-M565F

底片尺寸：609.6 × 685.8mm (24" x 27")

UVE-M565L

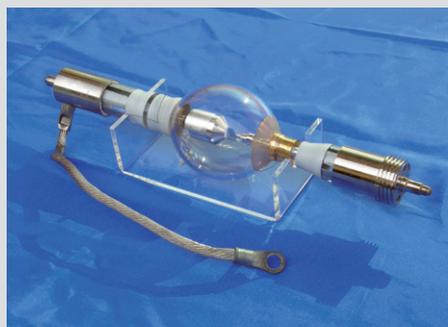
底片尺寸：660 × 812mm (26" x 32")

建議選配



紫外線量測表

EIT UV Meter



汞氙短弧燈

Short Arc Lamp

Leading in Thermal and UV Light Processing Equipment

UVE-M565F

UVE-M565L

適用範圍 Panel Dimension	電路板尺寸：305 x 355mm ~ 559 x 635mm (12" x 14" ~ 22" x 25") 電路板厚度：0.05 ~ 3.2mm 底片尺寸：609.6 x 685.8mm (24" x 27")	電路板尺寸：305 x 355mm ~ 610 x 762mm (12" x 14" ~ 24" x 30") 電路板厚度：0.05 ~ 3.2mm 底片尺寸：660 x 812mm (26" x 32")
光源系統 UV System	平行半角：< 2° 傾斜角：< 2° 均勻度：≥90% 強度：20mW/cm ² 曝光光源：5KW汞氙短弧燈 冷卻方式：內外循環控箱	
曝光方式 Exposure Method	雙面雙抬框曝光；Glass vs. Glass	
控制系統 System Control Features	觸控式螢幕配合 PC 及 PLC 作業	
對位系統 Alignment System	CCD數量：M565T → 2個CCD監控 M565F → 4個CCD監控 CCD移動：自動移動 製程板對位：自動對位 底片對位：自動底片對位	CCD數量：M565L → 4個CCD監控
固定方式 Attachment Method	製程板固定方式：使用 Φ3mm 擴張 Pin 底片固定方式：單溝槽式真空吸附 對位精度：自動對位 ±10μm	
產能 Capacity	約2~2.5片/分鐘 (不含底片清潔時間)	
環境要求 Clean Room	客戶置機空間 22°C ±2°C；55% ±5%RH 無塵室要求 CLASS 5000 at 0.5μm	
機台外型 Dimension	環控箱：L1300 x W700 x H1934 mm W1545 x D3513 x H2270mm (SUS)	W1735 x D3645 x H2316mm (SUS)
公用設備 Utilities	電力需求：16KVA；40A；3Φ (220V/60Hz；380V/50Hz) 電壓可依客戶需求 氣壓源：6kg/cm ² ；流量150~200L/min；Ø10快速接頭 冰水系統：5噸冰水機系統；循環水管管徑1"；排水管徑為3/4"；流量40L/min；進水溫度7~11°C；	

Due to C SUN continuing efforts to improve their systems, these specifications are subject to change without notice.
受長期研發需要，本公司保有規格修改之權利，恕不另行通知

DM201801-0500

業務洽詢專線： +86-139-26858077 (華南) +86-137-73105686 (華東) +886-922-583167 (臺灣)

steven@csun.com.tw

台北

新北市林口區工二工業區
工八路2-1號
TEL:886-2-26017706
FAX:886-2-26018854

台中

台中市南屯區
精科二路11號
TEL:886-4-23591651
FAX:886-4-23592678

廣州

廣州市花都區獅嶺鎮
利和路6號
TEL:86-20-86846341-3
FAX:86-20-86910139

東莞

東莞市大朗鎮長塘第三工業區78號
松湖雲谷雲松樓1樓
TEL:86-769-85331146
FAX:86-769-85331145

昆山

江蘇省昆山市高新區(玉山鎮)
恒盛路1369號
TEL:86-512-57780230
FAX:86-512-57780229